23Dp05

アニーリングによるバンドル状繊維構造の形態および電界電子放出特 性の変化

Changes of nano-tendril bundles morphology and field emission property by annealing

張 容実1)、梶田 信2)、皇甫 度均3)、田中 宏彦1)、大野 哲靖1) Zhang Rongshi 1), Kajita Shin 2), Hwangbo Dogyun 3), Tanaka Hirohiko 1), Ohno Noriyasu 1)

1) 名大院工、2) 名大未来研、3) 筑波大 1) Grad. Sch. Eng., Nagoya Univ., 2) IMaSS, Nagoya Univ., 3) Univ. of Tsukuba

タングステン(W)は金属の中で最も高い融 点を持ち、さらに低スパッタリング率、低水素 吸蔵率などの特性を有することから、ITERのダ イバータ材として使用される予定である。ダイ バータの熱負荷を低減するため、周辺プラズマ 中に不純物ガスを導入することでプラズマを 冷却する手法が考えられている[1]。

ヘリウムプラズマとWの相互作用により、W の表面には綿毛状の繊維構造(fuzz)が生じるこ とが分かっている[2]。近年、プラズマ冷却用の ネオン(Ne)、窒素(N₂)、アルゴン(Ar)などの不 純物ガスの追加導入により、fuzzとは異なる nano-tendril bundles (NTB)と呼ばれるバンドル 状の繊維構造がW表面に生じることが発見さ れた[3]。NTB構造は金属表面でのアークを引き 起こし、ダイバータ材料の損耗を加速させる恐 れがある[4]。先行研究により、fuzzは1673 Kの 温度でアニーリングすることにより、W表面か ら除去することができた[5]。しかし、アニーリ ングによるNTBの構造変化はまだ調査されて いない。本研究では、W表面で形成されたNTB をアニーリングし、その際のNTBの表面構造と 電界放出特性の変化を調査した。

NTB構造の形成は直線型ダイバータ模擬装 置NAGDIS-IIを用いて行った。定常のHe-Ne混 合プラズマをW試料へ入射することにより、試 料表面にNTBを形成させる。入射イオンエネル ギーは250 eVである。NTBをWの表面に形成し た後、W試料を赤外線加熱炉の中に設置し、 1673 Kの温度で1時間アニーリングした。アニー リング後、試料を真空チャンバー内に設置し、 高電圧電源を用いて、高電圧印加時の電界電子 放出電流を測定した。アニーリングによるNTB の形態変化は走査型電子顕微鏡(SEM)と共焦



図1 アニーリング前後のNTB構造における電界電 流特性(両極間距離d = 1 mm)。

図1に試料に印加した電界と電界放出電流 の関係を示す。アニーリング前の試料では、1.3 kV/mmの電界から、電界放出電流の立ち上がり が確認された。それに対して、アニーリング後 の試料では~3 kV/mmから、電界放出電流がゆっ くりと上昇した。また、アニーリング後の電界 放出電流は、アニーリング前と比べて大幅に減 少した。SEM観察の結果、アニーリング後の NTBを構成するファイバの先端が丸くなり、フ ァイバ径が太くなったことから、NTB先端部分 の長さ半径比が減少することがわかった。これ らの結果は、アニーリング手法がNTBからの電 界電子放出を弱める効果をもつことを示唆す る。

[1] A. Loarte et al., Nucl. Fusion 47 (2007) S203.

[2] D. Hwangbo et al., Nucl. Fusion 58 (2018) 096022.

[3] S. Takamura, N. Ohno, D. Nishijima, et al., Plasma Fusion Res. 1 (2006) 051.

[4] D. Sinelnikov *et al.*, IEEE Trans. Plasma Sci. **47(11)** (2019) 5186-5190.

[5] G. M. Wright *et al.*, J. Nucl. Mater. **463** (2015), 294-298.